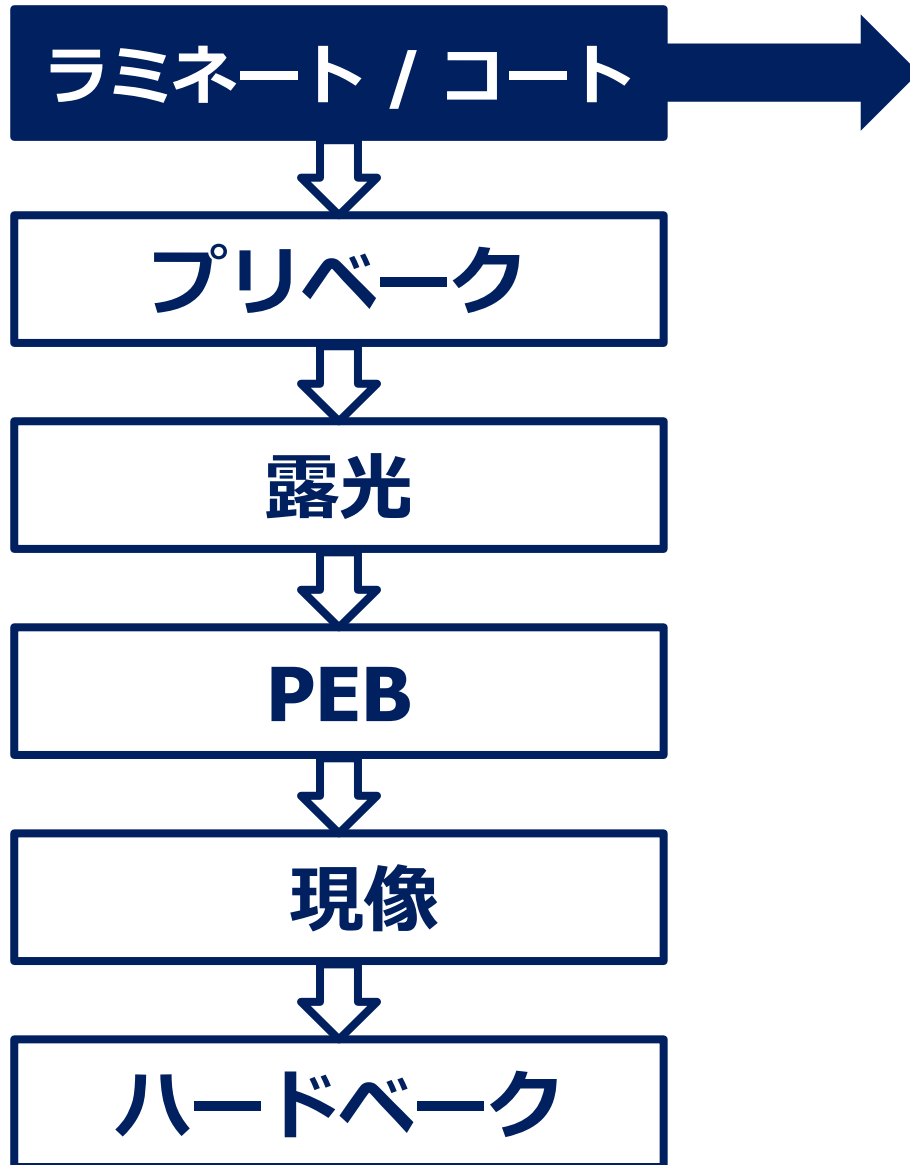


4. 評価体制

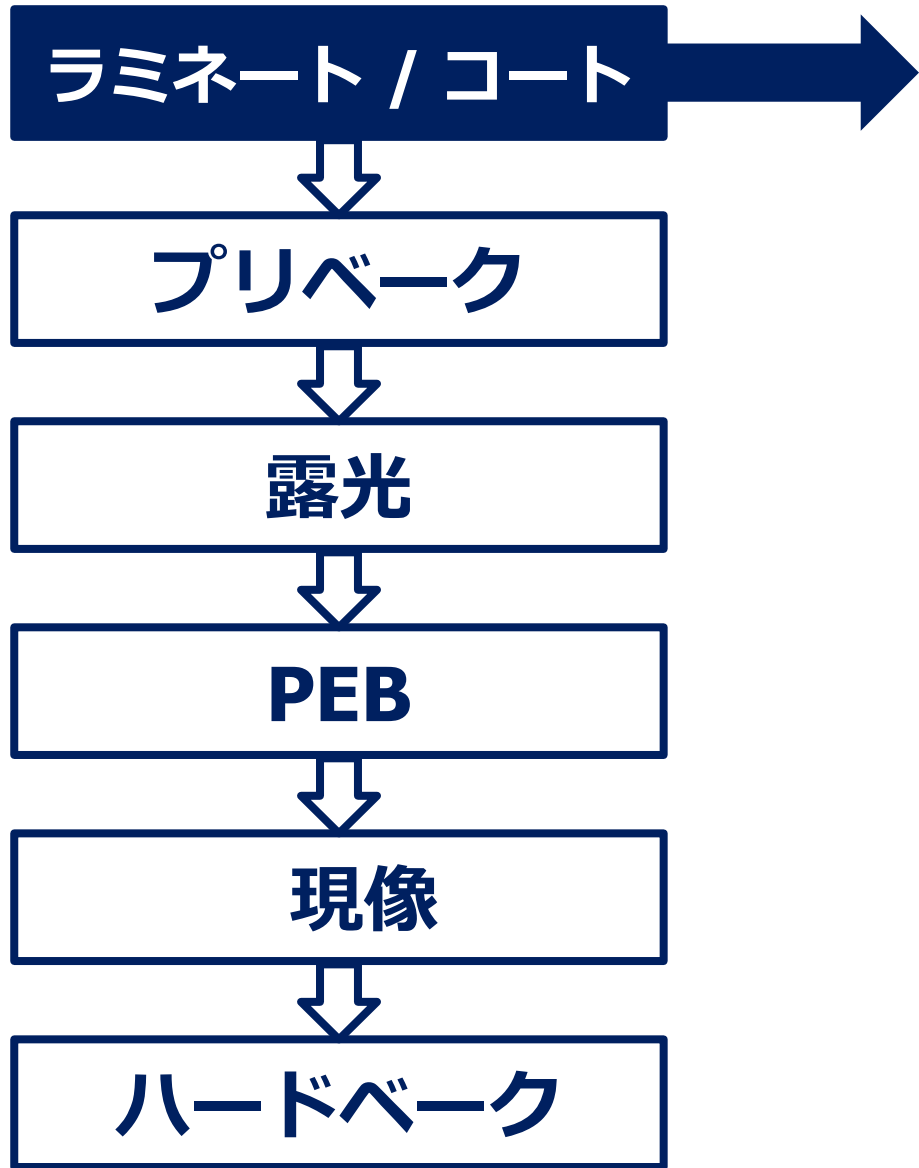


ラミネータ

- メーカー: 大成ラミネーター
- ロール幅: <550mm
- スピード: ~3.3m/min
- 温度: ~160度
- 圧力: ~0.5MPa



4. 評価体制



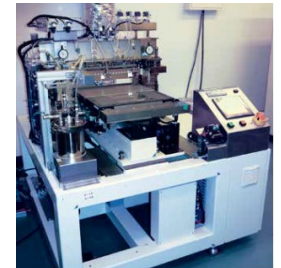
スピナー

	パラメータ
ウエハサイズ	2-12"
温度	23度
最大回転数	5000rpm
時間制御	0.1秒~99秒
ウエハ搬送	手動

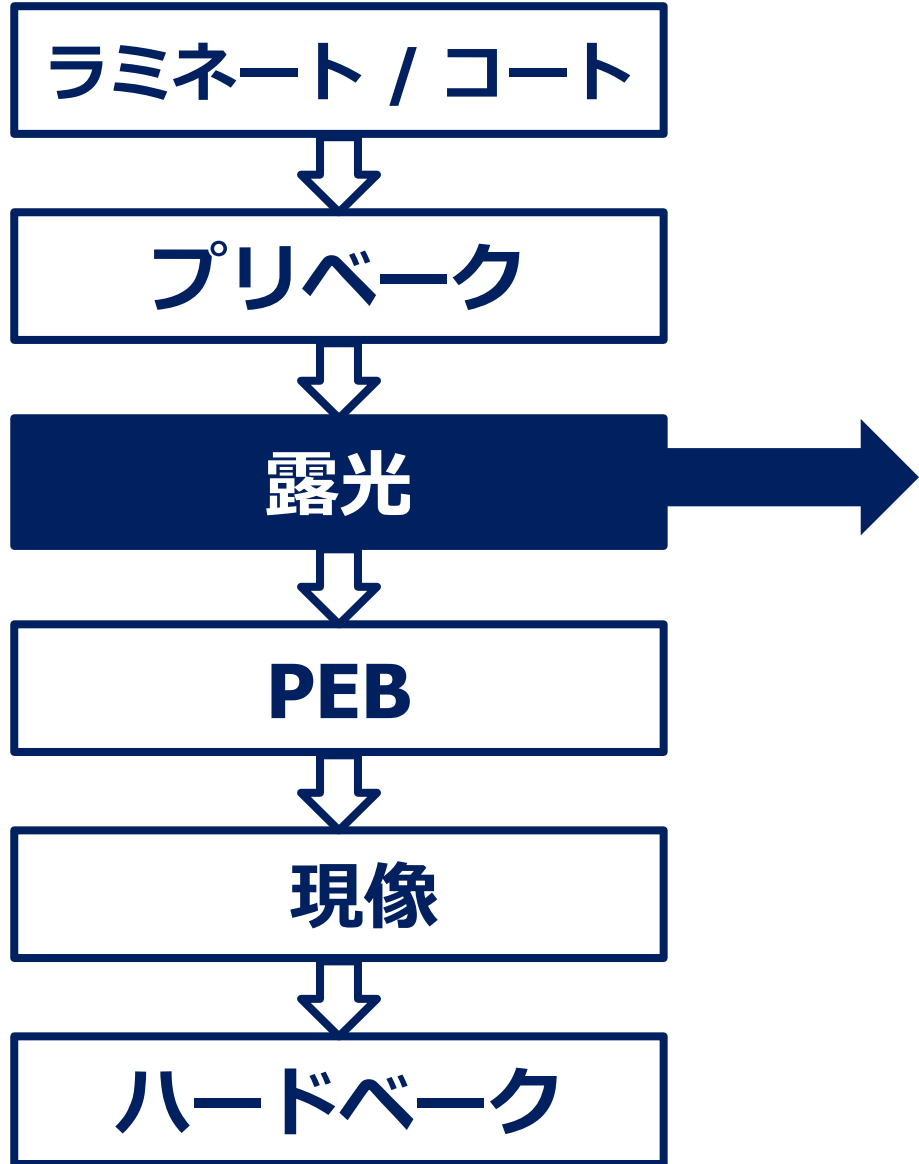


スリットコーター

装置寸法	1,000mmW x 1,500mmD	1,300mm W x 2,000mmD
基板種類	硝子基板、フィルム基板、セラミックス基板、ガラエポ基板、金属箔 等	
基板寸法	100~300 mm□	300mm□
材料種類	塗布型機能性材料(フォトリソ材料、OC材料、BM材料、PI材料、UV材料 等)	



4. 評価体制



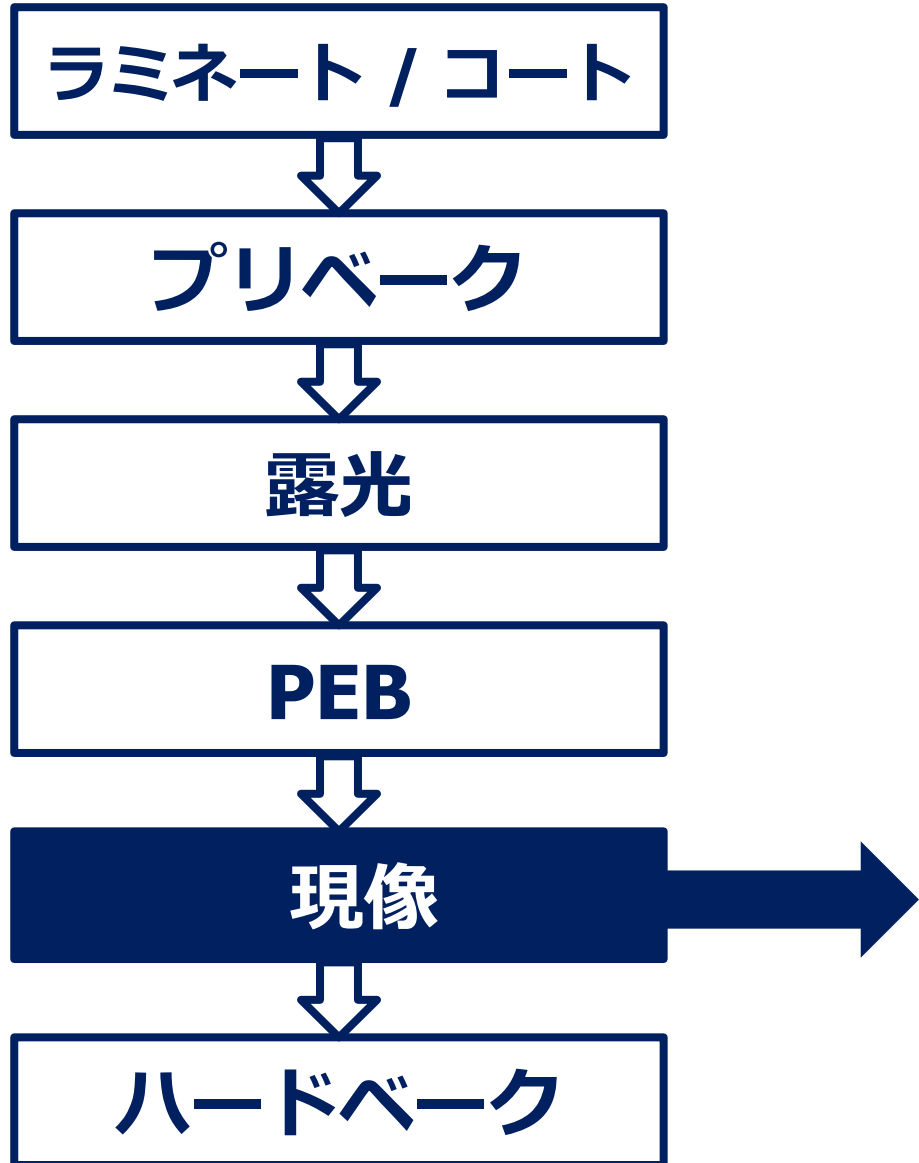
デモ機#1
CMS (基板サイズ<650x550mm)



Evaluation Target
- L/S=2/2 (For SAP)

*2018年01月現在

4. 評価体制

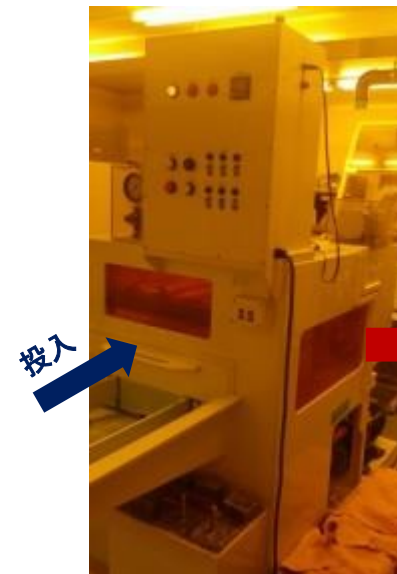


液浸 / パドル (手動)

- 現像液: TMAH Type
- 温度: 23度
- 時間管理: ストップウォッチ

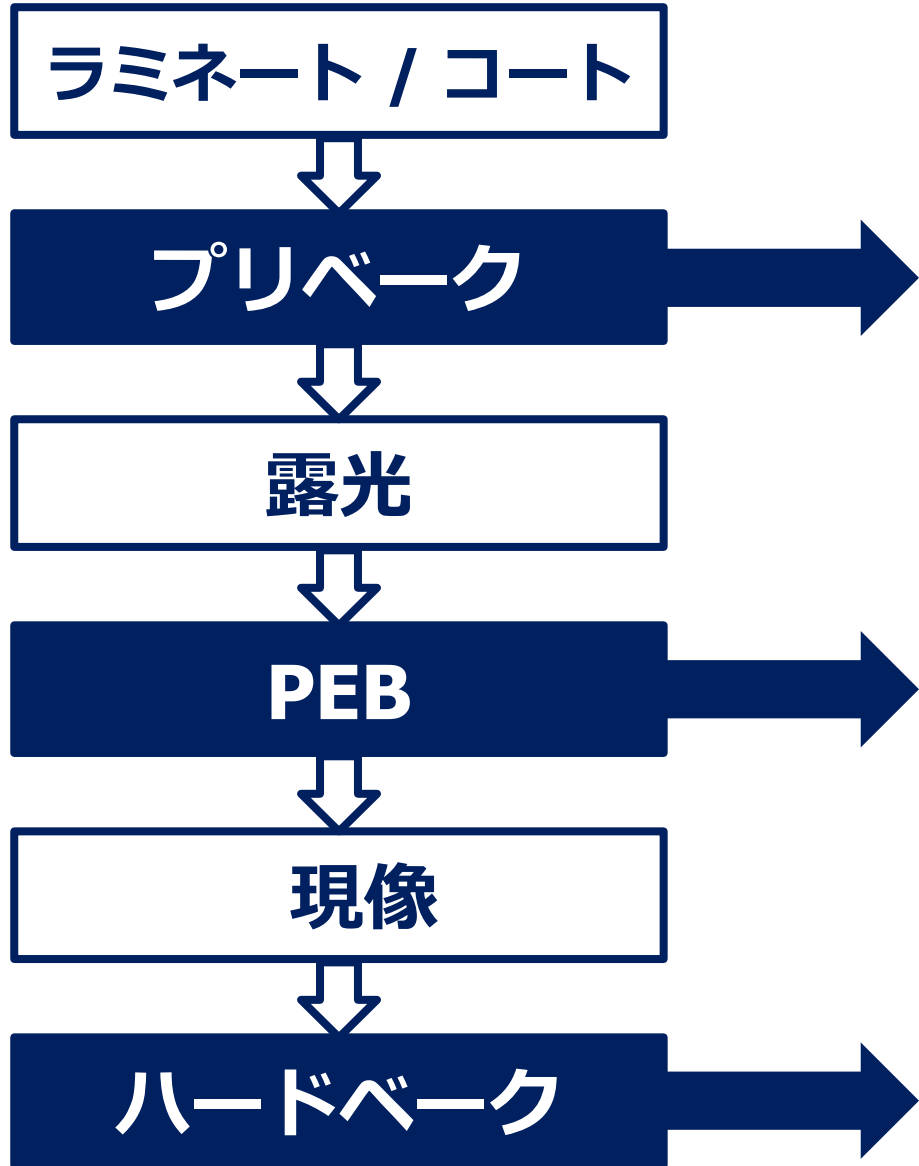
スプレー現像機 (内製)

- 現像液: Na_2CO_3
- 圧力: 0 - 0.25MPa
- 温度: 25-35度
- 基板サイズ: <510x610mm, 片面のみ
- 時間管理: ストップウォッチ



スプレーノズル
: オシレーション付

4. 評価体制



ホットプレート / オブブン

	パラメータ
基板サイズ	2-12"
温度	23度-250度
時間制御	ストップウォッチ
搬送	手動



ホットプレート



オブブン

4. 評価体制



投影露光装置 デモルーム

本社: 門前仲町1番出口より徒歩10分



- ・露光装置
 - ・DFR ラミネーター
 - ・スピンコーター
 - ・乾燥炉/ホットプレート
 - ・スプレー現像機
- 塗布～露光～現像まで
対応可能

スリットコーター/ CVS/ Akro デモ ルーム



- ・スリットコーター
- ・Akrometrix社製
反り測定器
- ・CVS めっき液分析機

サマ

検索